PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of:

MORITA et al.

New Application: Unknown

Filed: July 14, 2003 Attorney Dkt. No.: 8215.133

For: EXPOSURE APPARATUS AND METHOD OF CONVEYING MASK AND

WORK

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

July 14, 2003

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2002-264584 filed September 10, 2002 in Japan

In support of this claim, certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of these/this document(s).

Please charge any fee deficiency or credit any overpayment with respect to this paper to Deposit Account No. 50-0548.

Respectfully submitted,

Matthew Stavish

Registration No. 36,286

LINIAK, BERENATO & WHITE 6550 Rock Spring Drive Suite 240 Bethesda, Maryland 20817

Telephone: (301) 896-0600 Facsimile: (301) 896-0607

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postage Service as First Class Mail in an envelope addressed to Commissioner of Patents and Trademarks, Washington DC 20231 on

Antoinette Sakadales

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 9月10日

出願番号

Application Number:

特願2002-264584

[ST.10/C]:

[JP2002-264584]

出 願 人 Applicant(s):

株式会社オーク製作所

2002年11月 5日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 太田信一郎

特2002-264584

【書類名】 特許願

【整理番号】 P7090000RC

【提出日】 平成14年 9月10日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41F 21/00

G03H 1/00

G03B 3/00

G03F 15/00

H01L 21/30

【発明者】

【住所又は居所】 東京都調布市調布ケ丘3丁目34番地1号

株式会社オーク製作所内

【氏名】 森田 亮

【発明者】

【住所又は居所】 東京都調布市調布ケ丘3丁目34番地1号

株式会社オーク製作所内

【氏名】 中沢 朗

【特許出願人】

【識別番号】 000128496

【氏名又は名称】 株式会社オーク製作所

【代理人】

【識別番号】 100064414

【弁理士】

【氏名又は名称】 磯野 道造

【電話番号】 03-5211-2488

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 015392

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9714280

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】露光装置およびその方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ワークの搬入および搬出を行なうと共に整合作業を行なう搬入搬出位置と、ワークに紫外線を含む光を照射して露光作業を行なう露光位置とに亘ってそれぞれ交互に搬送される第1テーブル体および第2テーブル体を介してワークを露光する露光装置であって、

前記搬入搬出位置および前記露光位置に亘って上下2段に配置された第1搬送 経路および第2搬送経路と、この第2搬送経路上で搬入搬出位置に配置された前 記第1テーブル体と、前記第1搬送経路上で露光位置に配置された前記第2テー ブル体と、前記両テーブル体のそれぞれを異なる前記搬送経路に昇降移動させる 昇降機構と、この昇降機構により昇降移動させた前記両テーブル体を前記搬入搬 出位置または露光位置にそれぞれ搬送する搬送機構と、この搬送機構により前記 搬出搬入位置に搬送された前記両テーブル体の一方にワークを搬入してマスクと の整合作業を行なう整合機構、ならびに、前記搬送機構により前記露光位置に搬 送された前記両テーブル体の他方に紫外線を含む光を照射する光照射機構と、を 備え、

前記両テーブル体は、ワークを載置するためのステージ板と、前記マスクをあらかじめ設置するための上側透光板とをそれぞれ有することを特徴とする露光装置。

【請求項2】

ワークの搬入および搬出を行なうと共に整合作業を行なう搬入搬出位置と、ワークに紫外線を含む光を照射して露光作業を行なう露光位置とに亘ってそれぞれ交互に搬送される第1テーブル体および第2テーブル体を介してワークを露光する露光装置であって、

前記搬入搬出位置および前記露光位置に亘って上下2段に配置された第1搬送 経路および第2搬送経路と、この第2搬送経路上で搬入搬出位置に配置された前 記第1テーブル体と、前記第1搬送経路上で露光位置に配置された前記第2テー



ブル体と、前記両テーブル体にそれぞれに昇降ガイドを介して係合して配置され、前記両テーブル体のそれぞれを異なる前記搬送経路に昇降移動させる昇降機構と、この昇降機構により昇降移動させた前記両テーブル体を前記昇降ガイドに係合した駆動手段によりそれぞれ搬送する搬送機構と、この搬送機構により前記搬出搬入位置に搬送された前記両テーブル体の一方にワークを搬入してマスクとの整合作業を行なう整合機構、ならびに、前記搬送機構により前記露光位置に搬送された前記両テーブル体の他方に紫外線を含む光を照射する光照射機構と、を備え、

前記両テーブル体は、ワークを載置するためのステージ板と、前記マスクをあらかじめ設置するための上側透光板とをそれぞれ有することを特徴とする露光装置。

【請求項3】

前記両テーブル体の上側透光板は、前記マスクを設置するための透光板と、この透光板の側辺で前記露光位置から前記搬入搬出位置に向かう搬送方向に対して前方となる位置に設けたフレーム体と、このフレーム体から突出して設けた位置決め基準突部とを有し、

前記両テーブル体の前記上側透光板を載置する位置に、前記フレーム体に対向 する前記上側透光板の側辺を着脱自在に係合するコ字状開口を備える透光板係合 部を備えることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の露光装置。

【請求項4】

前記搬入搬出位置には、前記上側透光板の位置決め基準突部に対して当接離間 自在に設けた当接基準部を備え、

前記第2搬送経路に沿った位置には、前記上側透光板の透光板係合部を押動して前記位置決め基準突部を前記当接基準部に押圧させるための押圧手段を備えることを特徴とする請求項3に記載の露光装置。

【請求項5】

前記第1テーブル体および第2テーブル体のそれぞれは、前記上側透光板と前記ステージ板とを対面させて離間した状態で支持する躯体枠と、この躯体枠で支持する上側透光板およびステージ板のマスクにワークを真空吸着するための真空

吸着機構とを備えることを特徴とする請求項1から請求項4までのいずれか1項 に記載の露光装置。

【請求項6】

前記躯体枠は、そのステージ板を支持する支持部分に、あらかじめ設定された 前記ステージ板の支持基準位置に誘導するための誘導機構を備えることを特徴と する請求項5に記載の露光装置。

【請求項7】

前記躯体枠は、前記上側透光板を搬送方向に沿ってスライド移動させるための押動板を有するスライド手段を備え、

前記第2搬送経路に沿った位置には、前記押動板に当接離間する当接押動部を備えると共に、前記スライド手段を介してスライド移動した前記上側透光板を搬入搬出位置に搬送された前記ステージ板に対面する位置まで移動させるための上側透光板移動手段を備えることを特徴とする請求項5または請求項6に記載の露光装置。

【請求項8】

前記躯体枠は、前記両搬送経路に沿って配置される両側辺の一方に設けた搬送 ローラと、この搬送ローラと対向する前記両側辺の他方に設けられ前記昇降ガイ ドに係合される係合部とを備え、

前記両搬送経路には、前記搬送ローラが移動するための移動レールを備え、前 記第1搬送径路の移動レールは、前記搬送ローラが前記昇降機構により昇降移動 できる切欠部と、この切欠部に対して前記搬送ローラの補助搬送経路を出没自在 に保持する補助レール機構と、を備えることを特徴とする請求項5から請求項7 までのいずれか1項に記載の露光装置。

【請求項9】

前記搬送機構の駆動手段は、前記搬入搬出位置から前記露光位置を囲む周囲に 配置され、前記両テーブル体の昇降ガイドを支持する駆動ベルトと、この駆動ベ ルトをガイドするベルトガイドとを備えることを特徴とする請求項2から請求項 8までのいずれか1項に記載の露光装置。

【請求項10】

前記昇降機構は、前記搬出搬入位置から前記露光位置に亘って配置され前記両テーブル体の搬送方向に対して左右となるいずれか一方側と他方側でその第1テーブル体と第2テーブル体にそれぞれ係合される第1昇降棹および第2昇降棹と、この第1昇降棹および第2昇降棹に沿ってそれぞれ配置される第1回転中心棹および第2回転中心棹と、この第1回転中心棹および前記第1昇降棹を長手方向に直交する方向で支持する第1リンク体および前記第2回転中心棹および前記第2昇降棹とを長手方向に直交する方向で支持する第2リンク体と、前記両リンク体について前記両回転中心棹を中心として回転方向に移動させるリンク駆動部とを備えることを特徴とする請求項1から請求項9までのいずれか1項に記載の露光装置。

【請求項11】

ワークを搬入すると共に、露光済のワークを搬出する搬入搬出位置に配置され上側透光板とステージ板を有する第1テーブル体と、露光位置に整合作業済のワークおよびマスクを真空密着した状態で配置され上側透光板とステージ板を有する第2テーブル体とを、搬入搬出位置から露光位置に亘って上下に設けた第1搬送経路および第2搬送経路に昇降機構により前記両テーブル体のそれぞれを昇降移動させると共に、その両搬送経路に沿って搬送機構を介して搬送し、前記搬入搬出位置に搬送された前記両テーブル体の一方に対して整合機構により整合作業を行い、かつ、露光位置に搬送された前記両テーブル体の他方に対して紫外線を含む光を照射して露光作業を行なう露光方法であって、

搬入搬出位置の第1テーブル体のステージ板上にワークを搬入するステップと、搬入されたワークに対して前記露光位置の下方側で待機していたマスクを保持する第1テーブル体の上側透光板をスライドさせ対面させるステップと、露光位置で露光が終了したワークとマスクとの真空密着を解除するステップと、前記搬入搬出位置の対面しているワークとマスクとを真空密着して整合作業を行なうステップと、整合作業が終了したワークおよびマスクを保持する前記第1テーブル体、および、露光位置のマスクとワークとが離間した状態で保持する前記第2テーブル体とを前記昇降機構を介して第1搬送経路および第2搬送経路にそれぞれ昇降移動させるステップと、前記搬入搬出位置で上昇移動した第1テーブル体を

露光位置に搬送すると共に、露光位置で降下移動した第2テーブル体のワークを 支持するステージ板を、マスクを支持する上側透光板と分離して搬入搬出位置に 搬送するステップとを含むことを特徴とする露光方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、プリント配線板など枚葉のワークを露光する際に使用される露光装置に係り、特に、搬入搬出位置のワークと露光位置のワークとを交互に整合作業および露光作業を行なうことができる露光装置およびその方法に関するものである。

【従来の技術】

[0002]

従来、プリント配線基板、液晶パネル、液晶用のカラーフィルタなどワークに対して電子回路等の図形パターンを露光形成するために、所定波長の紫外線をワークに照射して露光処理する露光装置は、様々なものが提案されており、ワークを作業者が搬入、搬出する所謂半自動露光装置と、搬入から搬出まで装置が自動的に行う完全自動露光装置がある。

[0003]

例えば、一例として図14に示すようなものがある。図14は従来の露光装置の全体を模式的に示す模式図である。図14に示すように、半自動露光装置としての露光装置100は、搬入搬出位置H1と、露光位置下方R1とにワークを支持する第1テーブル101および第2テーブル102とを搬送する搬送機構103と、この搬送機構103により搬入搬出位置H1から露光位置下方R1に搬送された両テーブル101,102のいずれか一方のワークWおよびマスクMを載置する載置板101a(102a)を露光位置R2に上昇移動させ、かつ、露光位置R2にあるワークWおよびマスクMを載置する載置板101a(102a)を露光位置下方R1に降下移動させてそれぞれのテーブル101(102)のいずれか一方に載置するための昇降機構104と、この昇降機構104により上昇移動させたワークWおよびマスクを載置する載置板101a(102a)のいず



れか一方と真空密着して保持する上側フレーム105と、この上側フレーム105に紫外線を含む光を、光学系106を介して照射する光照射機構107と、搬入搬出位置H1に設置された撮像手段108および整合テーブル109ならびにマスク保持機構110と、を備えている。

[0004]

そのため、半自動露光装置(露光装置)100の搬入搬出位置H1に配置されている第1テーブル101の載置板101aにワークWを載置すると共に、マスクMをそのワークWに合せて設置する。つぎに、撮像手段108によりマスクMとワークWの整合マーク(図示せず)を撮像する。そして、ワークWを整合移動する場合は、マスク保持機構110によりマスクMを吸着保持すると共に、マスクMの少なくとも一部をワークWから所定距離だけ離間させ、整合テーブル109により載置板101aを整合移動させる。さらに、マスク保持機構110を降下してマスクMとワークWとを重ねて配置し、撮像手段108により撮像して両マーク(図示せず)が整合許容範囲であれば、マスクMとワークWの整合作業が終了して、その位置でマスクを粘着テープなどの固定手段で載置板101a上に固定する。

[0005]

つぎに、搬送機構103を作動させ第1テーブル101を露光位置下方R1に 搬送すると共に、露光位置下方R1の第2テーブル102を搬入搬出位置H1に 搬送する。さらに、露光位置下方R1に搬送された第1テーブル101の載置板 101aを昇降機構104により上昇移動させ、露光位置R2に設置されている 上側フレーム105に真空密着させることで合体させる。そして、上側フレーム 105と載置板101aにより挟持されているマスクMおよびワークWに対して 光照射機構107からの照射光を、光学系106を介して照射させることで、マスクMのパターンをワークWに露光形成する露光作業を行なっている。

[0006]

露光作業が終了したワークWおよびマスクMは、上側フレーム105と載置板101aとの真空密着が解除されることで、その上側フレーム105から分離して、載置板101aに載置された状態で昇降機構104に受け取られ、その昇降

機構の降下に伴って露光位置下方R2に待機している第1テーブル101に降下 移動して支持される。

一方、露光作業が行なわれている間に、第2テーブル102では、ワークWとマスクMとの整合作用が第1テーブル101で行なわれた状態と同様に行なわれている。

[0007]

そのため、搬入搬出位置H1にある両テーブル101,102の一方では、整合作業が行なわれ、露光位置下方R1にある両テーブル101,102の他方では、露光位置R2において露光作業が行なわれ、交互に整合作業、露光作業が繰り返し行なうことができるものである。なお、第1テーブル101と第2テーブル102では、露光位置下方R2の位置で高さが異なる状態となるが、昇降機構104の昇降移動の距離を変えることで上側フレーム105に当接離間できるように対応している。

[0008]

また、他の構成における露光装置では、前記構成の半自動露光装置100の第1テーブル101と第2テーブル102が搬送される露光位置下方R1において、紫外線を含む光を照射することで、露光作業を行なっているものも知られている。この露光装置では、ワークを載置する両テーブルが、マスクを保持する透光板を開閉することでワークをマスクに対面する位置に設置する構成としている。なお、この露光装置では、互い違いに露光位置下方に搬送される両テーブルの一方に対して、光照射する時間を変えることで、高さ方向の距離の異なるワークに対して適正な露光状態を維持するように対応している。

[0009]

【特許文献1】

特開平8-43950号公報(段落番号0043~0082)

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来の露光装置では、さらに改良する余地があり、以下で示す問題を 解決する必要があった。 (1)従来の露光装置は、ワークを交互に搬送する第1テーブルおよび第2テーブルからワークを載置する載置板を、昇降機構を介してそれら両テーブルから分離して上昇させて上側フレームに合体させることで露光位置にワークを設定するため、ワークとマスクとが整合状態を保ったまま露光位置に真空密着して設置されるまでに、その整合状態を維持することが困難であった。また、搬入搬出位置と露光位置とに交互に両テーブルを搬送することと、両テーブルの搬送経路を切替えて昇降移動させる動作を両立する構成のものは存在しなかった。さらに、整合作業を行なう場合に、両テーブル位置の高さがことなるため、整合テーブルにより同一高さで整合作業を行なうことに比較して余計な動作制御が必要になってしまった。

[0011]

(2)従来の露光装置は、マスク側となる透光板に対して周囲を囲む金属フレームを設置する構成であるため、透光板の初期あるいは段取替え時におけるその 透光板の設定作業を必要としていた。

[0012]

(3)従来の露光装置は、マスクとワークとの整合作業を行なう場合に、マスクを保持するマスク保持機構を介してワークを整合移動させる構成としているが、構造が複雑で、作業者が粘着テープなどの固定手段を使用するなど作業者が介在することになってしまった。

[0013]

(4) 従来の露光装置は、マスクとワークとを整合させる状態に設置する場合に、マスクおよびワークの両者を作業者が設置しなければならず、搬入搬出作業が面倒であった。また、透光板が開閉することでワークを設置するタイプの露光装置では、透光板の開口を行なう操作が作業者に大きな労働負担を与えると共に、透光板の開口に伴う動作により撮像手段が衝突しない位置まで退避する必要が生じた。

[0014]

(5) 従来の露光装置は、搬入搬出位置および露光位置に亘って上下2段に搬送経路を確保して、両テーブルを交互に搬送する構成と、搬入搬出位置および露

8

光位置において整合作業および露光作業を同じ高さで行なうために、搬送機構からテーブルを分離する構成をとるため、大きな重量を上下に移動制御する必要が 生じてその移動制御に対応する大きな動力が必要になった。

[0015]

V

本発明は、前記の問題点に鑑み創案されたものであり、交互に搬送されるワークに対して高さ方向における整合位置および露光位置が異なることがなく、また、ワークの整合作業を行なう場合に作業者が介在することがなく、さらに、透光板の周囲を囲む金属フレームを必要とせず、マスクが設置される上側透光板の操作が容易となる露光装置およびその方法を提供することを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】

本発明に係る露光装置は、前記の問題を解決するため、つぎのように構成した 。すなわち、ワークの搬入および搬出を行なうと共に整合作業を行なう搬入搬出 位置と、ワークに紫外線を含む光を照射して露光作業を行なう露光位置とに亘っ てそれぞれ交互に搬送される第1テーブル体および第2テーブル体を介してワー クを露光する露光装置であって、前記搬入搬出位置および前記露光位置に亘って 上下2段に配置された第1搬送経路および第2搬送経路と、この第2搬送経路上 で搬入搬出位置に配置された前記第1テーブル体と、前記第1搬送経路上で露光 位置に配置された前記第2テーブル体と、前記両テーブル体のそれぞれを異なる 前記搬送経路に昇降移動させる昇降機構と、この昇降機構により昇降移動させた 前記両テーブル体を前記搬入搬出位置または露光位置にそれぞれ搬送する搬送機 構と、この搬送機構により前記搬出搬入位置に搬送された前記両テーブル体の一 方にワークを搬入してマスクとの整合作業を行なう整合機構、ならびに、前記搬 送機構により前記露光位置に搬送された前記両テーブル体の他方に紫外線を含む 光を照射する光照射機構と、を備え、前記両テーブル体は、ワークを載置するた めのステージ板と、前記マスクをあらかじめ設置するための上側透光板とをそれ ぞれ有する構成とした。

[0017]

このように構成されることにより、露光装置は、露光作業が終了した両テーブ



ル体の一方と、整合作業が終了した両テーブル体の他方とが、昇降機構を介して搬入搬出位置から露光位置に亘って上下2段に配置された第1搬送経路から第2搬送経路に、あるいは、第2搬送経路から第1搬送経路に昇降移動することで経路を切替えられる。そして、マスクおよびワークを保持する第1テーブル体および第2テーブル体が交互に搬入搬出位置と露光位置とに搬送機構を介して搬送される。搬入搬出位置および露光位置は、第1搬送径路および第2搬送径路のいずれかにあれば、どちらが上でどちらが下となってもよい。また、両テーブル体は、上側透光板にマスクを設置しているため、マスクとワークとの整合マークを整合機構により直接撮像することができる。

[0018]

また、露光装置は、ワークの搬入および搬出を行なうと共に整合作業を行なう 搬入搬出位置と、ワークに紫外線を含む光を照射して露光作業を行なう露光位置 とに亘ってそれぞれ交互に搬送される第1テーブル体および第2テーブル体を介 してワークを露光する露光装置であって、前記搬入搬出位置および前記露光位置 に亘って上下2段に配置された第1搬送経路および第2搬送経路と、この第2搬 送経路上で搬入搬出位置に配置された前記第1テーブル体と、前記第1搬送経路 上で露光位置に配置された前記第2テーブル体と、前記両テーブル体にそれぞれ に昇降ガイドを介して係合して配置され、前記両テーブル体のそれぞれを異なる 前記搬送経路に昇降移動させる昇降機構と、この昇降機構により昇降移動させた 前記両テーブル体を前記昇降ガイドに係合した駆動手段によりそれぞれ搬送する 搬送機構と、この搬送機構により前記搬出搬入位置に搬送された前記両テーブル 体の一方にワークを搬入してマスクとの整合作業を行なう整合機構、ならびに、 前記搬送機構により前記露光位置に搬送された前記両テーブル体の他方に紫外線 を含む光を照射する光照射機構と、を備え、前記両テーブル体は、ワークを載置 するためのステージ板と、前記マスクをあらかじめ設置するための上側透光板と をそれぞれ有する構成とした。

[0019]

このように構成されることにより、露光装置は、搬入搬出位置においてワーク が第1ステージ体のステージ板に載置され上側透光板に設置されたマスクと整合 機構を介して整合作業が行なわれる。このとき露光位置にすでに整合作業が終了して搬送された第2テーブル体には、光照射機構を介して光照射され露光作業が行なわれる。そして、第1テーブル体側の整合作業が終了し、かつ、第2テーブル体の露光作業が終了すると、昇降機構により第1テーブル体は昇降ガイドを介して第1搬送径路に上昇して、また、第2テーブル体は昇降ガイドを介して第2搬送径路に降下する。さらに、搬送径路を切り替えられた両テーブル体は、搬送機構の駆動手段を介して両昇降ガイドが移動することでそれぞれの搬送径路を搬送され第1テーブル体が露光位置に搬送され、また、第2テーブル体が搬入搬出位置に搬送される。

[0020]

さらに、前記露光装置において、前記両テーブル体の上側透光板は、前記マスクを設置するための透光板と、この透光板の側辺で前記露光位置から前記搬入搬出位置に向かう搬送方向に対して前方となる位置に設けたフレーム体と、このフレーム体から突出して設けた位置決め基準突部とを有し、前記両テーブル体の前記上側透光板を載置する位置に、前記フレーム体に対向する前記上側透光板の側辺を着脱自在に係合するコ字状開口を備える透光板係合部を備える構成とした。

[0021]

このように構成されることにより、露光装置は、位置決め基準突部を作業者が 把持して引き抜くことで、第1テーブル体あるいは第2テーブル体の透光板係合 部から透光板の側辺を離脱させることができる。また、同様に作業者が位置決め 基準突部を把持して透光板の側辺を透光板係合部のコ字状開口から係合させるこ とができる。

[0022]

また、前記露光装置において、前記搬入搬出位置には、前記上側透光板の位置 決め基準突部に対して当接離間自在に設けた当接基準部を備え、前記第2搬送経 路に沿った位置には、前記上側透光板の透光板係合部を押動して前記位置決め基 準突部を前記当接基準部に押圧させるための押圧手段を備える構成とした。

[0023]

このように構成されることにより、露光装置は、搬入搬出位置の当接基準部に



対して、押圧手段を介して上側透光板の透光板係合部を押動することで、その上 側透光板の位置決め基準突部を押圧する。

[0024]

さらに、前記露光装置において、第1テーブル体および第2テーブル体のそれ ぞれは、前記上側透光板と前記ステージ板とを対面させて離間した状態で支持す る躯体枠と、この躯体枠で支持する上側透光板およびステージ板のマスクにワー クを真空吸着するための真空吸着機構とを備える構成とした。

[0025]

このように構成されることにより、露光装置は、ステージ板を整合移動させる整合テーブルが支持して躯体枠の支持部分から持ち上げた状態で整合作業を行い、ワークの整合移動が完了すると、マスクを保持する上側透光板に真空密着して合体する。また、露光作業が完了して上側透光板とステージ板との真空密着が解除されると、ステージ板はワークを載置した状態で、上側透光板から分離して下方に落下した状態で躯体枠に支持される。

[0026]

また、このように構成されることにより、露光装置は、搬入搬出位置では、整合機構によりワークをマスクに当接するように移動させ真空吸着機構によりマスクとワークが真空密着した状態で昇降機構により上昇させ搬送機構により、そのテーブル体を露光位置に搬送する。また、露光位置では、真空吸着機構が解除されることにより、上側透光板と露光済のワークを載置したステージ板とが躯体枠に離間した状態で支持され、昇降機構により降下させ搬送機構により搬入搬出位置に搬送される。

[0027]

そして、前記露光装置において、前記躯体枠は、そのステージ板を支持する支持部分に、あらかじめ設定された前記ステージ板の支持基準位置に誘導するための誘導機構を備える構成とした。

[0028]

このように構成されることにより、露光装置は、露光位置で、真空吸着機構が 解除されることにより、上側透光板と露光済のワークを載置したステージ板とが 躯体枠に離間した状態で支持されるとき、躯体枠の支持部分に設けた誘導機構が 上側透光板を、常に支持基準位置に誘導して支持する。なお、この誘導機構は、 例えば、上側透光板に設けた凹部に嵌合するように誘導ピンとしてもよい。

[0029]

また、前記露光装置において、前記躯体枠は、前記上側透光板を搬送方向に沿ってスライド移動させるための押動板を有するスライド手段を備え、前記第2搬送経路に沿った位置には、前記押動板に当接離間する当接押動部を備えると共に、前記スライド手段を介してスライド移動した前記上側透光板を搬入搬出位置に搬送された前記ステージ板に対面する位置まで移動させるための上側透光板移動手段を備える構成とした。

[0030]

このように構成されることにより、露光装置は、露光位置において上側透光板とステージ板とが離間された状態で躯体枠に支持され、搬送機構により搬入搬出位置に搬送される第2テーブル体(第1テーブル体)では、第2搬送径路に沿って移動すると上側透光板の押動板が、当接押動部に当接することで、スライド手段を介して躯体枠からスライドする。そして、躯体枠を支持しているステージ板が搬入搬出位置に露光済のワークを取り出しできる状態で搬送される。なお、搬入搬出位置で露光済のワークが取り出され、新たなワークがステージ板に載置されると、上側透光板移動手段により上側透光板を押動してスライド手段を介してステージ板の対面する位置まで移動させる。そして、ここでは、上側透光板移動手段が整合作業を行なう際に、その上側透光板を移動方向に押し続ける押圧手段の役割を兼ねることで、上側透光板を整合作業の際に一定位置に固定させる。

[0031]

また、前記露光装置において、前記躯体枠は、前記両搬送経路に沿って配置される両側辺の一方に設けた搬送ローラと、この搬送ローラと対向する前記両側辺の他方に設けられ前記昇降ガイドに係合される係合部とを備え、前記両搬送経路には、前記搬送ローラが移動するための移動レールを備え、前記第1搬送径路の移動レールは、前記搬送ローラが前記昇降機構により昇降移動できる切欠部と、この切欠部に対して前記搬送ローラの補助搬送経路を出没自在に保持する補助レ

ール機構と、を備える構成とした。

[0032]

このように構成されることにより、露光装置では、昇降ガイドが駆動手段を介して搬送機構により移動させられると、両テーブル体の係合部がその昇降ガイドにより、また、搬送ローラは移動レールに沿って、その両テーブル体のそれぞれが露光位置あるいは搬入搬出位置に搬送される。そして、第1搬送径路を移動する両テーブル体の一方は、移動レールの切欠部に突出して径路を確保する補助レール機構を介して搬送ローラが移動する。また、昇降機構を介して昇降移動する両テーブル体は、昇降ガイドに沿って係合部が移動し、かつ、搬送ローラが移動レールの切欠部を通過することで、上下に配置された搬送径路を切替えることができる。

[0033]

また、前記露光装置において、前記搬送機構の駆動手段は、前記搬入搬出位置から前記露光位置を囲む周囲に配置され、前記両テーブル体の昇降ガイドを支持する駆動ベルトと、この駆動ベルトをガイドするベルトガイドとを備える構成とした。

[0034]

このように構成されることにより、露光装置では、両搬送径路の搬入搬出位置 および露光位置に配置されている両テーブル体について、駆動ベルトを駆動させ ることで昇降ガイドを介して同期して搬送することができる。

[0035]

さらに、前記露光装置において、前記昇降機構は、前記搬出搬入位置から前記露光位置に亘って配置され前記両テーブル体の搬送方向に対して左右となるいずれか一方側と他方側でその第1テーブル体と第2テーブル体にそれぞれ係合される第1昇降棹および第2昇降棹と、この第1昇降棹および第2昇降棹に沿ってそれぞれ配置される第1回転中心棹および第2回転中心棹と、この第1回転中心棹および前記第1昇降棹を長手方向に直交する方向で支持する第1リンク体および前記第2回転中心棹および前記第2昇降棹とを長手方向に直交する方向で支持する第2リンク体と、前記両リンク体について前記両回転中心棹を中心として回転

方向に移動させるリンク駆動部とを備える構成とした。

[0036]

このように構成されることにより、露光装置では、リンク駆動部を作動させると、第1リンク体および第2リンク体が第1回転中心棹および第2回転中心棹を中心に所定角度回転することで、第1昇降棹および第2昇降棹の一方を上昇移動させ、また、他方を下降移動させる。そのため、両テーブル体の一方が昇降ガイドを介して上昇移動して、また、他方が昇降ガイドを介して下降移動する。

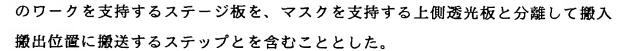
[0037]

また、露光方法として、ワークを搬入すると共に、露光済のワークを搬出する 搬入搬出位置に配置され上側透光板とステージ板を有する第1テーブル体と、露 光位置に整合作業済のワークおよびマスクを真空密着した状態で配置され上側透 光板とステージ板を有する第2テーブル体とを、搬入搬出位置から露光位置に亘 って上下に設けた第1搬送経路および第2搬送経路に昇降機構により前記両テー ブル体のそれぞれを昇降移動させると共に、その両搬送経路に沿って搬送機構を 介して搬送し、前記搬入搬出位置に搬送された前記両テーブル体の一方に対して 整合機構により整合作業を行い、かつ、露光位置に搬送された前記両テーブル体 の他方に対して紫外線を含む光を照射して露光作業を行なう露光方法であって、 以下のようにした。

[0038]

すなわち、搬入搬出位置の第1テーブル体のステージ板上にワークを搬入するステップと、搬入されたワークに対して前記露光位置の下方側で待機していたマスクを保持する第1テーブル体の上側透光板をスライドさせ対面させるステップと、露光位置で露光が終了したワークとマスクとの真空密着を解除するステップと、前記搬入搬出位置の対面しているワークとマスクとを真空密着して整合作業を行なうステップと、整合作業が終了したワークおよびマスクを保持する前記第1テーブル体、および、露光位置のマスクとワークとが離間した状態で保持する前記第2テーブル体とを前記昇降機構を介して第1搬送経路および第2搬送経路にそれぞれ昇降移動させるステップと、前記搬入搬出位置で上昇移動した第1テーブル体を露光位置に搬送すると共に、露光位置で降下移動した第2テーブル体





[0039]

このようにすることで、露光方法では、搬入搬出位置では、両テーブル体の一方で作業者が、露光済ワークあるいは新たなワークを、上側透光板を操作することなく、ステージ板から取り除くあるいは載置すると、整合作業が行なわれる。そして、このときすでに整合作業が終了して露光位置に搬送された両テーブル体の他方では露光作業が行なわれる。さらに、整合作業および露光作業が終了すると、昇降機構を介して両テーブル体が昇降移動することで、両搬送径路が切替えられ、搬送機構を介して両テーブル体の一方が露光位置に搬送されると共に、両テーブル体の他方が搬入搬出位置に搬送される。

[0040]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、ここでは露光装置は、その一例として、基板の両面を同時に露光処理する装置として説明する。図1は露光装置の全体を模式的に示す分解斜視図、図2は露光装置の第1テーブル体の構成を示す斜視図である。

[0041]

図1、図2および図6に示すように、露光装置1は、筐体2の手前となる位置 に作業者がワークWの搬入および搬出を行なう搬入搬出位置P1を設け、その搬 入搬出位置からその筐体2の奥側にそのワークWの露光位置P2を設けて構成されている。

[0042]

そして、この露光装置1は、搬出搬入位置P1とワークの露光位置P2とに亘って上下2段に配置した第1搬送経路L1および第2搬送経路L2と、この両搬送経路L1, L2(図6参照)に沿って搬送される第1テーブル体10と第2テーブル体20と、両テーブル体10,20を搬送経路L1,L2に沿って移動させる搬送機構5と、搬入搬出位置P1および露光位置P2にある両テーブル体10,20を昇降移動させ搬送経路を切替える昇降機構6と、両テーブル体10.



20の一方が露光位置から搬入搬出位置に移動する際に、その第1テーブル体10(または第2テーブル体20)の上側透光板11(21)およびステージ板12(22)をスライドさせて開閉するための、スライド手段9A、スライド開始手段9Bおよび上側透光板移動手段9Cを有する上側透光板スライド機構9と、搬出搬入位置P1に設けた整合機構3としての撮像手段3Aおよび整合テーブル4と、露光位置P2に紫外線を含む光を照射する光照射機構8とを備えている。

[0043]

はじめに、第1テーブル体10および第2テーブル体20の構成について説明する。なお、第1テーブル体10および第2テーブル体20は、搬送方向に対して左右が反対になるが同じ構成であるため、第1テーブル体10の構成を説明することで第2テーブル体20についての構成の説明を省略する。

[0044]

図1および図2に示すように、第1テーブル体10は、ワークWを整合移動させる整合テーブル4がステージ板12を支持することができる開口を備える躯体枠16と、この躯体枠16に対面して離間した状態で支持されている上側透光板11およびステージ板12と、上側透光板11を躯体枠16にスライド自在に支持するスライド手段9Cと、躯体枠16の搬送方向に対して左右となる一方の側辺に設けた搬送ローラ14と、この搬送ローラ14の反対側となる躯体枠16の側辺に設けた係合部16aと、を備えている。

[0045]

図1および図2に示すように、上側透光板11は、所定波長の紫外線を透過するアクリル板、あるいは、石英ガラス板、合成石英ガラス板などの透光板11aと、この透光板11aの手前側となる側辺(露光位置から搬入搬出位置に向かうときに前方となる側辺)に設けたフレーム体11bと、このフレーム体11bに突出して設けた位置決め基準突部11c、11cとを備えている。そして、上側透光板11の位置決め基準突部11c、11cは、フレーム体11の長手方向の幅に対して均等になる位置に配置されており、ここでは、後記する当接基準部2Aとの当接部分が、断面円形の金属フレームとなっており全体としてコの字状に形成されてフレーム体11bから水平方向に突出している。



[0046]

この位置決め基準突部11c, 11cは、ここでは2箇所に設けた構成としているが、一箇所であることや、また、3箇所以上であっても構わない。また、ここでは、位置決め基準突部11c, 11cは、作業者が把持して第1テーブル体10から上側透光板11を抜き取るために操作する把手としての役割も兼ねている。

[0047]

図2に示すように、第1テーブル体10の上側透光板11は、フレーム体11 bの位置と対向する透光板11aの側辺が、スライド手段9Aの上側透光板載置部9a4において後部側(露光位置P2側)に設けた透光板係合部11dに係合した状態で、その上側透光板載置部9a4に載置されている。この透光板係合部11dは、図2に示すように、コ字状の開口を備えており、透光板11aの側辺を、ほぼフレーム体11bと同様の形状で係合するもので、上側透光板載置部9a4に固定して設けられ、透光板11aの側辺を係合し易いように開口側の端部がその開口を大きくするように折り曲げて形成されている。

[0048]

この透光板係合部11dは、ここでは透光板11aの側辺に亘って形成されているが、透光板11aを係合してその上側透光板載置部9a₄に載置することができかつ、透光板11aの弛みを防止するものであれば、その設置長さおよび透光板11aの係合深さは限定されるものではない。さらに、図2および図4に示すように、透光板11aは、搬送方向に沿った両側辺では、L字状の規制部分15に沿って配置されている。なお、上側透光板11は、その位置決め基準突部11c,11cを作業者が把持して、透光板係合部11dから抜き取る方向に移動させると容易に取り外すことができる構成となっている。

[0049]

図 2 に示すように、上側透光板 1 1 を載置した状態で搬送方向に沿ってスライドさせるためのスライド手段 9 A は、躯体枠 1 6 の搬送方向に対して左右となる側辺に設けたスライドガイド 9 a_1 , 9 a_1 と、このスライドガイド 9 a_1 , 9 a_1 に摺動自在に設けたガイド摺動部 9 a_2 , 9 a_2 と、このガイド摺動部 9 a_2 , 9

[0050]

図2および図4に示すように、スライド枠9 a 3は、ここでは、躯体枠16上に支持されているステージ板12に対して、上側透光板11がマスクMおよびワークWを介在させた状態で整合移動できる空間を空けた状態で離間する高さ寸法に構成されている。

また、ストッパ板 9 a_5 は、第 2 搬送経路 L 2 (図 6 参照)に沿って設けた当接押動部 9 B に当接した時に、スライドガイド 9 a_1 , 9 a_1 に沿ってスライド枠 9 a_3 をスライド移動させるためのもので、ここでは、スライド枠 9 a_3 の側部に突出して、露光位置 P 2 から搬入搬出位置 P 1 に向かう搬送方向において前方となる位置に設けられている。このストッパ板 9 a_5 は、スライド枠 9 a_3 をスライド移動させることができれば、その形状、設置位置を特に限定されるものではない。

[0051]

図2および図4に示すように、第1テーブル体10のステージ板12は、躯体枠16に形成された支持部分に載置されており、ワークWの両面を露光する場合には、所定波長の紫外線を含む光を透過するアクリル板、石英板あるいは合成石英板などの透光板で形成されており、ここでは片面露光であるために平面性に優れた樹脂板12aと、この樹脂板12aの周縁部分に形成された凹部12c,12cを備えている。なお、樹脂板12aの搬送方向に対して前後の側片に対応する位置には、搬送方向に対して左右となる躯体枠16の左右の部分に掛け渡して設けたフレーム体12bが当接するように配置されている。このフレーム体12bは、ステージ板12の弛みを防止するためのものである。

[0052]

ステージ板12の凹部12cは、躯体枠16の支持部分から突出させて設けた

誘導ピン (誘導機構) 13に係合することで、あらかじめ決められた原点位置に常に配置されるように構成されている。なお、図4に示すように、このステージ板12は、ステージ板12の凹部12cの開口部分に傾斜面を備えるか、あるいは誘導ピン13の頂点から周縁に向かって傾斜面を備える構成としている。これは、ステージ板12が整合作業の時に整合移動して、露光作業が終了して上側テーブル体11との真空密着が解除された場合、そのステージ板12が落下したときに、誘導ピン13に凹部12cが係合し易くするためである。

[0053]

図 2 および図 4 に示すように、第 1 テーブル体 1 0 の躯体枠 1 6 は、ステージ板 1 2 と上側透光板 1 1 とを対面させ離間した状態で支持できるように構成されており、ステージ板 1 2 の受面 1 6 b と、上側透光板 1 1 の載置面(ここでは上側テーブル体載置部 9 a_4)を備えている。そして、この躯体枠 1 6 の係合部 1 6 a(図 9 (a-1) 参照)は、搬送方向に対して左右となる一方の側辺で中央に設けられている。この係合部 1 6 a(図 9 (a-1) 参照)は、後記する昇降機構 6 の昇降移動をガイドする昇降ガイド 7 に係合すると共に、昇降機構 6 の第 1 昇降棹 6 f_2 が固定されている。

[0054]

さらに、図2および図7に示すように、躯体枠16の係合部16aとは対向する側辺に設けた搬送ローラ14,14は、搬送方向に対して前後となる2箇所に配置されており、各搬送ローラ14が上ローラ14aと下ローラ14bとをアングル材(中央の水平板の左端と右端に設けた垂直板を有する)14cで支持した状態で構成されている。そして、図11に示すように、ここでは、上ローラ14aは、第1搬送経路L1に沿って移動し(下ローラ14bは非接触状態)、また、下ローラ14bは、第2搬送経路L2に沿って移動する(上ローラ14aは非接触状態)ように構成されている。

[0055]

図8に示すように、上側透光板11のマスクMと、ステージ板12のワークWと、を着脱自在に真空吸着する真空吸着機構18は、マスクMとワークWとを上側透光板11およびステージ板12ならびに周縁シール(土手ゴム)11eを介

して真空密着するメイン真空吸着機構18aと、ステージ板12のワークWを保持するワーク真空吸着機構18bと、を備えている。

そのため、搬入搬出位置 P1 (図9参照)でワークWをステージ板12に載置する場合には、ワーク真空吸着機構18bが作動してワークWをステージ板12に真空吸着して保持する。そして、マスクMとワークWとを当接して真空密着する場合には、メイン真空吸着機構18aが作動する。

[0056]

図2に示すように、スライド手段9A、スライド開始手段9B、上側透光板移動手段9Cを有するスライド開閉機構9について説明する。なお、スライド手段9Aについてはすでに説明したので、ここでは、スライド開始手段9Bおよび上側透光板移動手段9Cについて説明する。

[0057]

図 2 に示すように、スライド開始手段 9 B は、第 2 搬送経路 L 2 (図 6 参照)に沿った位置で、ストッパ板 9 a_5 の移動軌跡上に出没して、そのストッパ板 9 a_5 に当接離間する当接押動部 9 b_1 と、この当接押動部 9 b_1 をストッパ板 9 a_5 に対して当接離間するように出没作動させる駆動部 9 b_2 とを備えている。このスライド開始手段 9 B は、第 1 テーブル体 1 0 と第 2 テーブル体 2 0 (図 6 参照)とに対応して、第 2 搬送経路 L 2 の搬送方向に対して左右になる位置に設けられて動作するように構成されている。また、ストッパ板 9 a_5 は、搬送ローラ 1 4 の搬送径路に対して障害とならない位置になるように搬送方向に対して直交する方向に突出して配置されている。

[0058]

図2に示すように、上側透光板移動手段9Cは、第2搬送経路L2に沿って、その第2搬送経路L2により搬送される第1テーブル体10あるいは第2テーブル体20の下方となる位置に配置された上側透光板搬送駆動部9c₁と、この上側透光板搬送駆動部9c₁と、この上側透光板搬送駆動部9c₁により駆動され、上側透光板11の透光板係合部11dに当接して搬入搬出位置側に押動する上側透光板押動部9c₂とを備えている。ここでは、上側透光板移動手段9Cの上側透光板押動部9c₂が、上側透光板11の位置決め基準突部11cを当接基準部2A(図3参照)に押圧する押圧手

段を兼ねる構成としている。なお、上側透光板押動部9c₂は、昇降移動できるように構成してもよく、上側透光板11の透光板係合部11dを押動する際に上昇し、動作が終了したときには、降下した位置に待機あるいはその状態で移動できるようになり都合がよい。

[0059]

図1および図2に示すように、搬入搬出位置P1に設けた整合機構3である撮像手段3A、整合テーブル4と、当接基準部2Aについて説明する。

整合機構3は、CCDカメラなどの撮像手段3Aと、この撮像手段3Aで撮像したマスクMとワークWの両整合マークMm, Wmとの位置を演算してワークWの整合移動距離を算出してワークWを整合移動させる整合テーブル4とを備えている。撮像手段3Aは、両整合マークMm, Wmを撮像する際に、認識が良くできるように露光処理が促進されることがない照明光を照射する構成にすると都合がよい。また、撮像手段3Aは、ワークWをステージ板12の所定位置に載置する際に、目印となる位置を示すレーザ光を照射する構成を備えていると都合がよい。なお、整合機構3は、撮像手段3Aで撮像した画像を作業者が目視できるように、搬入搬出位置P1の上方に設置されたディスプレイDに表示している。

[0060]

図1および図5に示すように、整合テーブル4は、ステージ板12を載置する整合載置台4aと、この整合載置台4aに載置するステージ板12を固定するために、その整合載置台4aに設けた穴部分から出没して真空吸着する吸着パッド4bと、整合載置台4aに吸着パッド4bにより吸着保持したステージ板12を、上下方向であるZ方向に移動すると共に、Z方向に直交する水平面方向の一方向であるX方向、このX方向に直交するY方向およびZ方向を中心とした回転方向であるθ方向に移動させる整合駆動部4cとを備えている。

[0061]

また、図3に示すように、当接基準部2Aは、第2搬送経路にある上側透光板 11のフレーム体11bから水平方向に突出している位置決め基準突部11cに 対して当接離間する当接位置決め部2cと、この当接位置決め部2cを支持する 駆動基部2bと、この駆動基部2bを前進後退自在に駆動させる駆動部2aとを 備えている。そして、当接位置決め部2 c は、ここでは、位置決め基準突部11 c の当接部分が円筒面に形成されているため、その位置決め基準突部11 c に平行に上下から挟み込む円筒面を回転自在に備えるように形成されている。なお、この当接位置決め部2 c は、位置決め基準突部11 c を繰り返し一定の位置に固定できる形状であれば特に限定されるものではない。この当接基準部2 a は、上側透光板11が搬入搬出位置P1(図6参照)の移動端まで搬送されるまでは待機しており、上側透光板11の搬入搬出位置P1への移動動作が終了したときに駆動部2 a の駆動により前進して位置決め基準突部11 c に当接するように、ここでは作動させている。

[0062]

つぎに、昇降ガイド7、搬送機構5および昇降機構6について説明する。

図1に示すように、昇降ガイド7は、両透光板10,20の係合部16a,26a(図9参照)を嵌合してスライドさせるスライド部7aと、このスライド部7aの裏面側に設けた搬送機構5側にスライド自在に係合するスライド係合部7bとを備えている。そして、この昇降ガイド7は、搬送機構5の駆動手段である駆動ベルト5bの所定位置に配置されその駆動ベルト5bに取り付けられている

[0063]

図1および図13に示すように、搬送機構5は、搬入搬出位置P1および露光位置P2を囲む周囲に設置した駆動ベルト5bと、この駆動ベルト5bを一定高さ位置で支持してその駆動ベルト5bの移動をガイドするベルトガイド5cと、昇降ガイド7,7の一方を保持して直線往復移動させることで駆動ベルト5bを駆動させる搬送アクチュエータ5aとを備えている。

[0064]

駆動ベルト5 b は、無端環状に形成され、ベルトガイド5 c と対面する位置に一定間隔で形成された凹凸面(図5参照)を備えている。そして、ベルトガイド5 c は、駆動ベルト5 b の凹凸面に噛み合って駆動ベルト5 を送る歯車状に形成されている。また、搬送アクチュエータ5 a と対面する位置の昇降ガイド7には、スライド係合部7 b が係合して直線往復移動できるように直線ガイド5 d を管

体2側に固定して設けている。ここで使用される搬送アクチュエータ5aは、昇降ガイド7を保持して直線往復移動できるものであれば、LMガイド、油圧シリンダ、空圧シリンダ、あるいは送りねじ機構など、特に限定されるものではない

[0065]

さらに、ここでは、搬送アクチュエータ5aを一方側だけに設けた構成として 説明したが、搬送アクチュエータ5aを両透光板10,20の搬送方向に対して 左右となる位置に設けて同期あるいは非同期状態で駆動できる構成としても良い 。搬送アクチュエータ5aを2箇所に設ける場合には、駆動ベルト5bおよびベ ルトガイド5cは不要となる。

[0066]

図7、図10および図11に示すように、第1搬送経路L1は、搬送方向に平行で、搬入搬出位置P1から露光位置P2に亘っては配置された左右の上ローラ移動レール31,31の搬送方向(長手方向)における中央に形成した切欠部31a₁,31a₂に対して搬送路を補充する補助レール機構35とを備えており、また、上ローラ移動レール31,31の両端位置には、昇降機構6により昇降移動する昇降補助レール6 g_1 ,6 g_2 ,6 g_2 を有している。

[0067]

図7および図10に示すように、上ローラ移動レール31,31は、筐体1A側に固定され、両テーブル体10,20が搬入搬出位置P1と露光位置P2に配置されたときの一方の搬送ローラ14(24)が昇降補助レール6 g_1 (6 g_2)に、また、他方の搬送ローラ14(24)が切欠部31 a_1 (31 a_2)に配置できる長さを有している。この上ローラ移動レール31,31は、左右に配置された一方が、第1テーブル体10の搬送ローラ14、14を移動させるためのものであり、左右に配置された他方が、第2テーブル体20の搬送ローラ24,24を移動させるためのものである。

[0068]

そして、この上ローラ移動レール31,31の中央に形成された切欠部31a



1,31a2は、第1テーブル体10が搬入搬出位置P1に配置され、第2テーブル体20が露光位置P2に配置されているときに、搬送ローラ14の上ローラ14aと、搬送ローラ24の上ローラ24aとが並列できる大きさに形成されている。

[0069]

補助レール機構35は、上ローラ移動レール31,31の切欠部31 a_1 ,3 1 a_2 に対して同一平面上に配置されて補助する補助レール35b,35bと、この補助レール35b,35bを出没自在に駆動する補助レール駆動部35a,35aと、を備えている。そして、この補助レール機構35bは、後記する昇降機構6の昇降補助レール6b1(昇降補助レール6b2)と同期して作動するように構成されている。

[0070]

また、第2搬送経路L2は、第1搬送経路L1の下方で、その第1搬送経路L1の設置幅より小さな設置幅で左右に配置された下ローラ移動レール32,32 を備えている。この第2搬送径路L2の下ローラ移動レール32,32は、左右に配置された一方が、第1テーブル体10の搬送ローラ14、14の下ローラ14b,14bを移動させるためのものであり、左右に配置された他方が、第2テーブル体20の搬送ローラ24,24の下ローラ24b,24bを移動させるためのものである。

[0071]

図1および図9に示すように、昇降機構6は、搬入搬出位置P1から露光位置P2に亘って延び、両透光板10,20の下方で搬送方向に沿って平行に左右に配置された第1回転中心棹6e₁、第2回転中心棹6e₂と、この第1回転中心棹6e₁、第2回転中心棹6e₂と、この第1リンク体6c₁,第2リンク体6c₂と、この第1リンク体6c₁,第2リンク体6c₂に係合され第1回転中心棹6e₁、第2回転中心棹6e₂にそれぞれ並列して配置された第1昇降棹6f₁,第2昇降棹6f₂と、第1リンク体6c₁および第2リンク体6c₂を係合させ同期して作動させるための係合ロッド6dと、この係合ロッド6dを介して第1回転中心棹6e₁、第2回転中心棹6e₂を回転中心とし第1

リンク体 $6c_1$ および第 2 リンク体 $6c_2$ を所定角度に回転作動させるリンク駆動 部 6 a および押動ロッド 6 b とを備えている。また、この昇降機構 6 は、第 1 リンク体 $6c_1$,第 2 リンク体 $6c_2$ で、それぞれ第 1 昇降棹 $6f_1$,第 2 昇降棹 $6f_2$ とは反対側に係合して昇降動作する昇降補助レール 6g を作動させるように 構成されている。

[0072]

この昇降機構 6 の第 1 昇降棹 6 f_1 , 第 2 昇降棹 6 f_2 は、それぞれ第 1、第 2 テーブル体 1 0, 2 0 の中央となる位置で両テーブル体 1 0, 2 0 の左右側の係合部 1 6 a、 2 6 a に係合されている。そして、両リンク体 6 c_1 , 6 c_2 は、第 1 テーブル体 1 0,第 2 テーブル体 2 0 を、第 1 搬送経路 L 1、第 2 搬送経路 L 2 のそれぞれに昇降移動させて切替えられる回転中心からの長さ寸法を有している。この両リンク体 6 c_1 (6 c_2)は、第 1 回転中心棹 6 e_1 ,(第 2 回転中心棹 6 e_2)の左右に第 1 昇降棹 6 f_1 (第 2 昇降棹 6 f_2)および昇降補助レール 6 g を係合できるものであれば、その形状、大きさ、配置を特定されるものではない。

[0073]

つぎに、図6に示すように、光照射機構8について説明する。なお、ここでは 平行光をワークWに対して照射する構成について述べるが、メタルハライドラン プを用いて散乱光を使用する構成とするなど、露光装置で使用されることができ るものであれば限定されるものではない。

光照射機構40は、所定波長の紫外線を含む光を照射するショートアークランプなどの放電灯8aと、この放電灯8aの後方から覆うように配置された楕円反射鏡8bと、この放電灯8aおよび楕円反射鏡8bからの照射光のエネルギーを照射面に対して均等になるように調整するフライアイレンズ8cと、このフライアイレンズ8cからの照射光を反射する反射鏡8dと、この反射鏡8dからの反射光を平行光として露光位置P2に反射する反射鏡8eとを備えている。

なお、放電灯8aが設置されている空間は、仕切りを設けてワークW側と区分けすると共に、放電灯8a側の空間を冷却する冷却ファンなどの冷却機構(図示せず)を設置すると都合がよい。

[0074]

つぎに、露光装置1の動作についてワークWの搬入搬出動作、整合動作、昇降動作、搬送動作、露光動作、上側透光板分離動作、上側透光板スライド動作について説明する。

なお、はじめに、全体の動作の概要について図6および図13を参照して説明 する。

[0075]

図6および図13(a)に示すように、搬入搬出位置P1においてワークWが搬入され整合作業が終了した第1テーブル体10と、露光位置P2に配置され露光作業が終了(装置始動時は露光作業なし)している第2テーブル体20とは、図13(b)に示すように、昇降機構6を介して昇降ガイド7,7に沿って、第1テーブル体10が第1搬送径路L1に上昇移動して、かつ、第2テーブル体20が第2搬送径路L2に降下移動する。

[0076]

そして、図13(c)に示すように、第1テーブル体10は、露光位置P2に第1搬送径路L1に沿って搬送機構5を介して搬送され、また、第2テーブル体20は、搬入搬出位置P1に第2搬送径路L2に沿って搬送機構5を介して搬送される。このとき、第2テーブル体20は、上側透光板21が、上側透光板スライド機構9を介してステージ板22からスライド開口した状態となり、ステージ板22側が、搬入搬出位置P1に搬送される。また、露光位置P1に搬送された第1テーブル体10には、光照射機構8から光照射されて露光作業が行なわれる

[0077]

一方、搬入搬出位置P1に搬送された第2テーブル体20のステージ板にワークWが搬入されると、図13(d)および図6に示すように、上側透光板スライド機構9により上側透光板21がステージ板21と対面する位置まで搬送されて整合機構3および整合テーブル4を介して整合作業が行なわれる。図13(e)に示すように、整合作業が終了した第2テーブル体20と、すでに露光作業が終了して待機していた第1テーブル体10とが、昇降機構6を介して昇降移動して

搬送径路を切り替える。

[0078]

さらに、図13(f)および図6に示すように、第1テーブル体10は搬入搬出位置P1に、第2テーブル体20は露光位置P2に、搬送機構5を介して搬送される。なお、第1テーブル体10の上側透光板11は、上側透光板スライド機構9によりステージ板12からスライドして、搬入搬出位置P1に搬送されたステージ板12から露光済みワークWが搬出されて新たなワークWが搬入されると、図13(g)および図6に示すように、上側透光板スライド機構9によりステージ板12と対面する位置まで搬送される。

このように、露光装置1は、図13(a)~(g)の動作を繰り返してワーク Wを交互に整合作業、露光作業するものである。以下、各動作について詳細に説 明する。

[0079]

<ワークWの搬入作業>

図1および図6に示すように、第1テーブル体10および第2テーブル体20は、両搬送径路L1、L2の搬送端である搬入搬出位置P1と露光位置P2とに配置されており、搬入搬出位置P1の第1テーブル体10は、上側透光板11がスライドしてステージ板12にワークWを載置できる状態となっている。作業者がワークWを第1テーブル体10のステージ板12の上に載置するときは、整合機構3の図示しないレーザ照射機構からワークWの整合マークWmの位置を特定できるように赤外線レーザなどがピンポイントでレーザ照射されており、その位置に整合マークWmが合うようにワークWを載置する。

[0080]

2のワークWとを対面させる。

[0081]

[0082]

< 整合作業>

マスクMを備える上側透光板11の位置が固定されると、図8(a)、(b)に示すように、整合テーブル4の吸着パッド4b(図5参照)が上昇してステージ板12を吸着保持すると共に、整合載置台4aが上昇してステージ板12を、躯体枠16の載置部分から上昇させてワークWがマスクMと当接するように移動させる。そして、マスクMとワークWとが当接すると、メイン真空吸着機構18aを作動させマスクMとワークWとを真空密着させる。

[0083]

そして、整合機構3によりマスクMとワークWとの整合マークMm, Wm(図 1参照)を撮像して整合許容範囲外であれば、図8(c)に示すように、整合移動距離を演算して整合テーブル4に信号を送り、メイン真空吸着機構18aによる真空密着状態を解除すると共にワーク真空吸着機構18bを作動させてワークをステージ板12に真空吸着した状態で、整合テーブル4を整合駆動部4cにより降下させXY0方向に適宜整合移動させる。

[0084]

さらに、図8(d)に示すように、整合テーブル4を上昇させ、再びメイン真空吸着機構18aによりマスクMとワークWとを真空密着させ、整合機構3により整合マークMm, Wm(図1参照)を撮像して整合許容範囲内であれば、整合テーブル4は降下移動して、図8(e)に示すように、上側透光板11とステージ板12とを真空密着した状態で整合作業が終了する。

[0085]

つぎに、昇降機構6による昇降動作について説明する。

図9 (a-1)から(b-2)に示すように、整合作業が終了した状態の第1テーブル体10は、第2搬送径路L2の一方の搬送端である搬入搬出位置P1に配置されており、また、第2テーブル体20は、第1搬送径路L1の他方の搬送端である露光位置P2に配置されており、昇降機構6により、図9(b-1), (b-2)で示すように、互いに搬送径路を切替える。

[0086]

すなわち、昇降機構 6 は、リンク駆動部 6 a が作動して押動ロッド 6 b を所定間隔伸縮させると、第1 リンク体 6 c_1 が第1 回転中心棹 6 e_1 を中心にして所定角度回転すると共に、係合ロッド 6 d が第2 リンク体 6 c_2 を、第2 回転中心棹 6 e_2 を中心として所定角度回転させる。そのため、昇降機構 6 は、第1 昇降棹 6 f_1 を上昇移動させ、かつ、第1 昇降棹 6 f_2 を降下移動させることで第1 テーブル体 1 0 を昇降ガイド 7 に沿って上昇させ第1 搬送径路 L 1 に上昇移動させると共に、第2 テーブル体 2 0 を昇降ガイド 7 に沿って第2 搬送径路 L 2 に降下移動させる。

[0087]

このとき、第1テーブル体10の搬送ローラ14の上ローラを載置している昇降補助ローラ68 $_1$ は、上ローラ移動レールの位置まで上昇移動すると共に、第2テーブル体20の搬送ローラ14の上ローラを載置している昇降補助レール68 $_2$ は、降下移動する。

[0088]

そして、この昇降動作を行なうときには、第1テーブル体10は、昇降ガイド7に沿って係合部16 a がスライド上昇し、かつ、図10 (a)、(b) および図7に示すように、搬送方向に対して前方側(搬入搬出位置P1に向かう側)の搬送ローラ14 が昇降補助レール6 g_1 の上昇移動により上昇し、後方側の搬送ローラ14 が切欠部31 a 16 を下から上に通過することで、第11 リンク体6 c 10 所定角度の回転により、第2 搬送径路12 から第1 搬送径路11 に昇降移動する

[0089]

また、第2テーブル体20は、昇降ガイド7に沿って係合部16 a がスライド降下し、かつ、図10(d)、(e) および図7に示すように、搬送方向に対して前方側(露光位置P2に向かう側)の搬送ローラ24が昇降補助レール6 g_2 の降下移動により降下し、後方側の搬送ローラ24が切欠部31 a_2 を上から下に通過することで、第1リンク体6 c_2 の所定角度の回転により、第1搬送径路L1から第2搬送径路L2に降下移動する。

[0090]

なお、露光位置 P 2 の第 2 テーブル体 2 0 は、図 1 1 (a) に示すように、降下移動するときには、上側透光板 2 1 とステージ板 2 2 とが離間した状態、つまり、メイン真空吸着機構 1 8 a による吸引動作が解除され躯体枠 2 6 に支持された状態となっている。また、図 1 1 (b) に示すように、第 1 搬送径路 L 1 に上昇移動した第 1 テーブル体 1 0 は、上側透光板 1 1 にステージ板 1 2 がメイン真空吸着機構 1 8 a により真空吸着した状態で躯体枠 1 6 に支持された状態となっている。

そして、図9(a-1)~(d-2)に示すように、昇降機構6により両テーブル体10,20は、搬入搬出位置P1と露光位置P2とで、順次昇降移動して搬送径路を切替えている。

[0091]

つぎに、搬送動作について説明する。

第1テーブル体10は、図1および図12(a-1)~(c-2)に示すように、搬送機構5の搬送アクチュエータ5aが動作して第2テーブル体20側の昇降ガイド7を搬入搬出位置P1に向かって移動されると、その昇降ガイド7に固定されている駆動ベルト5bがベルトガイド5cに係合した状態で送られ、第1テーブル体10が係合している昇降ガイド7が、直線ガイドに沿って、かつ、搬送ローラ14が上ローラ移動レールに沿って、露光位置P2側に送られることで搬送される。

[0092]

このとき、図10(b)、(c)、(d)に示すように、第1搬送径路L1の

補助レール機構 35 が補助レール 35 b を切欠部 31 a $_1$ に出力して搬送路を確保しているため、第 1 テーブル体 10 の搬送ローラ 14 の上ローラ 14 a 14 a は、スムーズに上ローラ移動レールに沿って移動することができる。そして、露光位置 P 2 に搬送された第 1 テーブル体 10 の前方側の上ローラ 14 a は、図 10 (d) に示すように、昇降補助レール 6 g g に載置された状態となっている

[0093]

一方、第2テーブル体20は、搬入搬出位置P1に向かって搬送される場合に、上側透光板21とステージ板22とが別々に搬送される。すなわち、図1および図12(a-1)~(c-2)に示すように、搬送機構5の搬送アクチュエータ5aが動作して昇降ガイド7を搬入搬出位置P1に向かって移動させると、第2テーブル体20は、搬送ローラ24の下ローラ24bが下ローラ移動レールに沿って移動することで搬入搬出位置P1に向かって搬送される。

[0094]

このとき、第2搬送径路L2の途中に配置されたスライド開始手段9Bの当接押動部9 b_1 が、駆動部9 b_2 により上昇して、ストッパ板9 a_5 に当接することで、図2および図12(b-1),(b-2)に示すように、スライド枠9 a_3 を躯体枠26のスライドガイド9 a_1 に沿ってスライドさせ、上側透光板21を待機させた状態で、躯体枠26側、つまり、ステージ板22側を搬入搬出位置P1に搬送する。

[0095]

なお、搬入搬出位置P1に搬送される第2テーブル体の下ローラ14bは、搬送径路L2の下ローラ移動レール32に沿って移動し、前方側の搬送ローラ14の上ローラ14aが昇降補助レール6g2に載置する。また、搬入搬出位置P1に搬送されたステージ板22が、すでに露光済のワークWを保持している場合には、ワーク真空吸着機構18bの動作が解除され、露光済のワークWが搬出される。このとき、作業者は、すでに上側透光板21がスライド開口しているのでワークWを取り出す作業を行なうだけでよい。

[0096]

そして、第2テーブル体20のステージ板22にワークWが前記した手順で載置されると、スライド開始手段9Bの当接押動部9 b_1 が、駆動部9 b_2 により降下して、図2および図12(c-1)~(d-2)に示すように、上側透光板移動手段9Cの上側透光板押動部9 c_2 が、上側透光板搬送駆動部9 c_1 を作動して上側透光板21の透光板係合部21 dを押動することで、スライド枠9 a_4 を躯体枠26のスライドガイド9 a_1 に沿って移動させ上側透光板21をスライド板22側に対面する位置まで搬送する。さらに、整合作業の際にすでに説明したような作業が行なわれる。

[0097]

<露光作業>

なお、露光位置 P 2 に搬送された第1テーブル体10には、光照射機構8の放電灯8 a から紫外線を含む光が、光学系 (8 b ~ 8 e)を介して一定時間照射されることで露光作業が行なわれている。この露光作業は、露光位置 P 2 に搬送される両テーブル体10,20が、常に、高さ方向において一定の位置となることと、マスクMが上側透光板11,21にあらかじめ固定された状態で行なわれることから、露光精度が安定した状態となる。

[0098]

このようにして、露光装置1は、整合作業、露光作業、昇降移動、搬送を繰り返し行うことにより、両テーブル体10,20を介してワークWを順次交互に露光処理するものである。

[0099]

なお、前記した露光装置1では、第1搬送径路L1の搬送端に露光位置P2を配置して、第2搬送径路L2の搬送端に搬入搬出位置P1を配置した構成として説明したが、第1搬送径路L1に搬入搬出位置P1を、第2搬送径路L2に露光位置P2を配置しても構わない。

[0100]

また、露光装置1では、昇降機構6としてリンク機構を一例として説明したが、搬入搬出位置P1と露光位置P2とにリフトピン昇降機構(図示せず)を設け、両テーブル体10,20を昇降作動させる構成としても構わない。このとき、

昇降ガイド7,7を備える構成としてもよく、また、昇降ガイド7,7を用いない場合には、搬送径路に沿って移動すると共に、その搬送径路に沿って両テーブル体10,20が移動できるように、出没する係合爪(図示せず)を備える構成とすると都合がよい。

[0101]

さらに、前記した露光装置1では、搬送機構5として駆動ベルト5bおよびベルトガイド5cを用いて両テーブル体10,20を搬送移動させるように構成しているが、駆動アクチュエータ5aを左右に設けて同期させて作動する構成としても構わない。

[0102]

【発明の効果】

本発明に係る露光装置は、以上のように構成しているため以下に示すように優れた効果を奏する。

(1)露光装置は、ステージ板に支持されたワークをあらかじめマスクが設置された上側透光板を備える第1テーブル体および第2テーブル体を搬入搬出位置および露光位置に搬送機構および昇降機構を介して交互に搬送することで整合作業および露光作業を行なうため、露光位置では、両テーブル体のそれぞれが同一高さ位置で露光作業を行なうことができる。また、作業者が操作する工程を減らして整合作業および露光作業を精度よく行なうことができる。

なお、露光装置は、上側透光板およびステージ板の構成が簡素化され、ステージ板について躯体枠から移動させるため、従来の装置のようにテーブル体全体を 搬送機構から分離させて上下させることはなく、ステージ板を昇降移動させるための最小限の駆動力で足りる。

[0103]

(2)露光装置は、昇降ガイドを介して昇降機構が両テーブル体を第1搬送径路または第2搬送径路に昇降移動させ、その昇降ガイドが移動手段を介して搬送機構により移動させることで、両テーブル体のそれぞれを露光位置および搬入搬出位置に搬送することができるため、露光位置では、両テーブル体のそれぞれが同一高さ位置で露光作業を行なうことができる。また、露光装置では、搬入搬出

位置において、マスクとワークの整合作業が対面した状態で行なわれるため、整 合精度が向上した状態で露光することが可能となる。

[0104]

(3)露光装置は、マスクを設置する上側透光板が、透光板の側片に設けたフレーム体から突出する位置決め基準突部を作業者が把持して、両テーブル体に設けた透光板係合部のコ字状開口に、その透光板のフレーム体とは対向する側片を着脱自在にしているため、構成が簡略化でき、両テーブル体から分離、係合する操作を容易かつスムーズに行なうことができる。

[0105]

(4)露光装置は、搬入搬出位置に設けた当接基準部に、押圧手段がその上側 透光板の透光板係合部を押動することで、上側透光板の位置決め基準突部を押圧 するため、整合作業を行なう場合に整合精度を保つことが可能となる。

[0106]

(5)露光装置は、両テーブル体の躯体枠に上側透光板とステージ板とを離間した状態で載置しているため、搬入搬出位置では、整合機構によりワークがマスクに当接するように移動すると真空吸着機構によりマスクとワークが真空密着した状態で昇降機構により上昇して搬送機構により露光位置に搬送される。また、露光位置では、真空吸着機構が解除されることにより、上側透光板と露光済のワークを載置したステージ板とが躯体枠に離間した状態で支持され、昇降機構により降下して搬送機構により搬入搬出位置に搬送される。そのため、マスクとワークの整合マークを実際に撮像して整合作業ができ、かつ、躯体枠に分離された状態でステージ板が支持される場合に、常に基準位置にステージ板を誘導することが可能となる。

[0107]

(6)露光装置は、露光位置で真空吸着機構の動作が解除されると、露光済ワークを載置するステージ板が上側透光板と離間して、躯体枠の支持される支持部分の誘導機構によりあらかじめ決められた支持基準位置に誘導される。そのため、整合作業により整合移動したステージ板は、常に支持基準位置から整合作業が行なうことができる。

[0108]

(7) 露光装置は、搬送機構により搬入搬出位置に搬送される第2テーブル体(第1テーブル体)が、当接押動部に押動板を当接させることで、スライド手段を介して躯体枠からスライドして、躯体枠を支持しているステージ板が搬入搬出位置に露光済のワークを取り出しできる状態で搬送される。そのため、搬入搬出位置で露光済のワークが容易に取り出され、あらたなワークがステージ板に対して容易に載置させることができる。また、露光装置は、上側透光板移動手段により上側透光板を押動してスライド手段を介してステージ板の対面する位置まで移動させ、上側透光板移動手段が整合作業を行なう際に、その上側透光板を移動方向に押し続ける押圧手段の役割を兼ねることで、上側透光板を整合作業の際に一定位置に固定させる。そのため、露光装置は、上側透光板の構成を簡略化することが可能となる。

[0109]

(8)露光装置は、搬送機構により両搬送径路に沿って搬送される両テーブル体が、移動レールを移動する搬送ローラと昇降ガイドに係合する係合部とにより安定して搬送される。そして、昇降機構によって昇降移動する両テーブル体は、昇降ガイドに沿って係合部が昇降移動すると共に、搬送ローラが移動レールの切欠部を介して昇降移動して搬送径路が切替えられるため、装置全体をコンパクトに構成することができる。

[0110]

(9)露光装置は、搬送機構の駆動手段を駆動ベルトおよびベルトガイドを備えることで、搬送機構の構成が簡略化され、かつ、同期させることで両テーブル体を正確に搬送することができる。

[0111]

(10)露光装置は、昇降機構のリンク駆動部により両リンク体を、両回転中心棹を中心に所定角度回転移動させ、両昇降棹を上下移動させることで、両テーブル体を昇降移動させるため、狭いスペースであっても設置できると共に、確実に両搬送径路に両テーブル体を切り替えることができる。

[0112]

(11)露光方法では、搬入搬出位置で作業者が、露光済ワークあるいは新たなワークを、上側透光板を操作することなく、ステージ板から取り除くあるいは 載置することができる。また、整合作業および露光作業が、両テーブル体ともに 同一高さ位置で行なわれるため、精度を確保して作業者の操作負担を軽減することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明に係る露光装置の全体を模式的に示す分解斜視図である。
- 【図2】 本発明に係る露光装置の第1テーブル体(第2テーブル体)の構成を示す斜視図である。
- 【図3】 本発明に係る露光装置の搬出搬入位置における当接基準を示す斜視図である。
- 【図4】 本発明に係る露光装置の整合テーブルの構成を模式的に示す模式図である
- 【図5】 本発明に係る露光装置の搬出搬入位置における整合テーブルの構成を 示す斜視図である。
- 【図6】 本発明に係る露光装置の全体の構成を模式的に示す模式図である。
- 【図7】 本発明に係る露光装置の両搬送径路の構成を示す平面図である。
- 【図8】 (a)~(e)は本発明に係る露光装置の整合動作を説明する模式図である。
- 【図9】 (a-1)~(d-2)は本発明に係る露光装置における昇降動作と 搬送動作を示す模式図である。
- 【図10】 (a)~(f)は本発明に係る露光装置における昇降動作と搬送動作を示す模式図である。
- 【図11】 (a), (b) は本発明に係る露光装置の両テーブル体の搬送径路における状態を示す模式図である。
- 【図12】 $(a-1) \sim (d-2)$ は本発明に係る露光装置の両テーブル体の搬送径路における上側透光板とステージ板の構成を示す模式図である。
- 【図13】 (a)~(g)は本発明に係る露光装置の両テーブル体における全体の動作を示す模式図である。

【図14】 従来の露光装置の全体を模式的に示す模式図である。

【符号の説明】

1	露光装置
2	筐体
2 A	当接基準部
2 a	駆動部
2 b	駆動基部
2 c	当接位置決め部
3	整合機構
3 A	撮像手段
4	整合テーブル
4 a	整合載置台
4 b	吸着パッド
4 c	整合駆動部
5	搬送機構
5 a	搬送アクチュエータ
5 b	駆動ベルト(駆動手段)
5 с	ベルトガイド(駆動手段)
5 d	直線ガイド
6	昇降機構
6 a	リンク駆動部
6 b	押動ロッド
6 c ₁	第1リンク体
6 c ₂	第2リンク体
6 d	係合ロッド
6 e ₁	第1回転中心棹
6 e ₂	第2回転中心棹
6 f ₁	第1昇降棹
6 f ₂	第2昇降棹

6	6g ₁ (6g ₂)	昇降補助レール
7	7	昇降ガイド
8	3	光照射機構
8	3 a	放電灯
8	ВЪ	楕円反射鏡
8	3 с	フライアイレンズ
8	3 d	反射鏡
8	Ве	反射鏡
9		上側透光板スライド機構
9	Α	スライド手段
9	a 1	スライドガイド
9	a 2	ガイド摺動部
9	a 3	スライド枠
9	a 4	上側透光板載置部
9	a 5	ストッパ板(押動板)
9	В	スライド開始手段
9	b ₁	当接押動部
9	b ₂	駆動部
9	C	上側透光板移動手段(押圧手段)
9	c ₁	上側透光板搬送駆動部
9	c 2	上側透光板押動部
1	0 (20)	第1テーブル体(第2テーブル体)
1	1 (21)	上側透光板
1	1 a (21a)	透光板
1	1 b (21b)	フレーム体
1	1 c (21c)	位置決め基準突部
1	1 d (21d)	透光板係合部
1	2 (22)	ステージ板
1	2 a (22a)	樹脂板

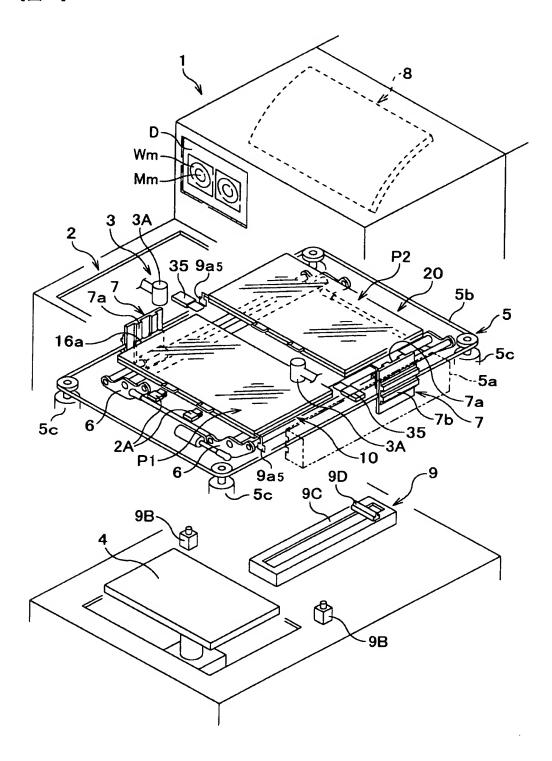
12b (22b)	フレーム体
12c (22c)	凹部
13,23	誘導ピン(誘導機構)
14,24	搬送ローラ
14a (24a)	上ローラ
14b (24b)	下ローラ
15, 25	規制部分
16,26	躯体枠
16a, 26a	係合部
16b, 26b	受面
18,28	真空吸着機構
18a (28a)	メイン真空吸着機構
18b (28b)	ワーク真空吸着機構
3 1	上ローラ移動レール
3 1 a ₁ (3 1 a ₂)	切欠部
3 2	下ローラ移動レール
3 5	補助レール機構
3 5 a	補助レール駆動部
3 5 Ъ	補助レール
P 1	搬入搬出位置
P 2	露光位置
L 1	第1搬送経路
L 2	第2搬送経路
D	ディスプレイ
M	マスク
Mm	整合マーク
W	ワーク

整合マーク

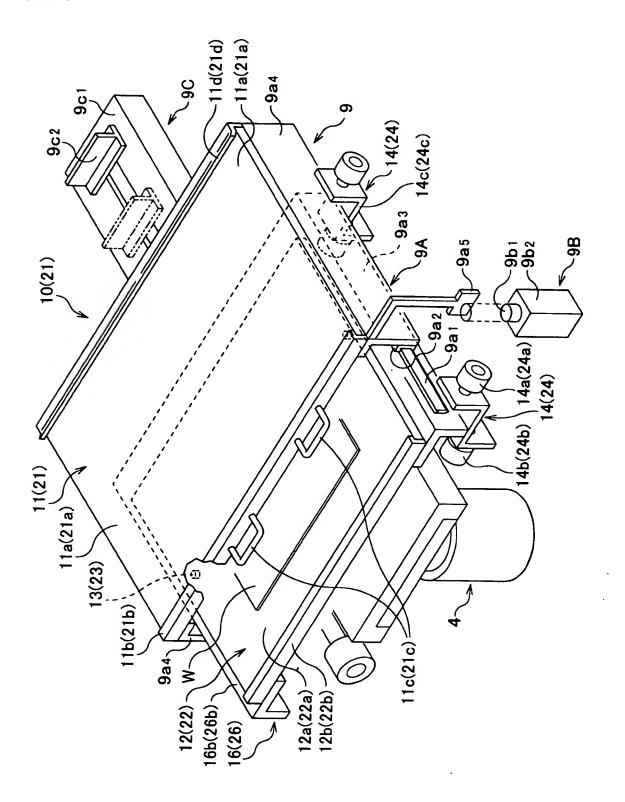
Wm

【書類名】 図面

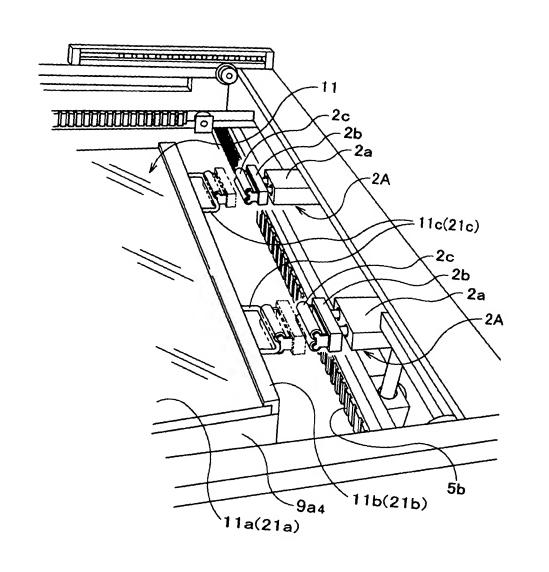
【図1】



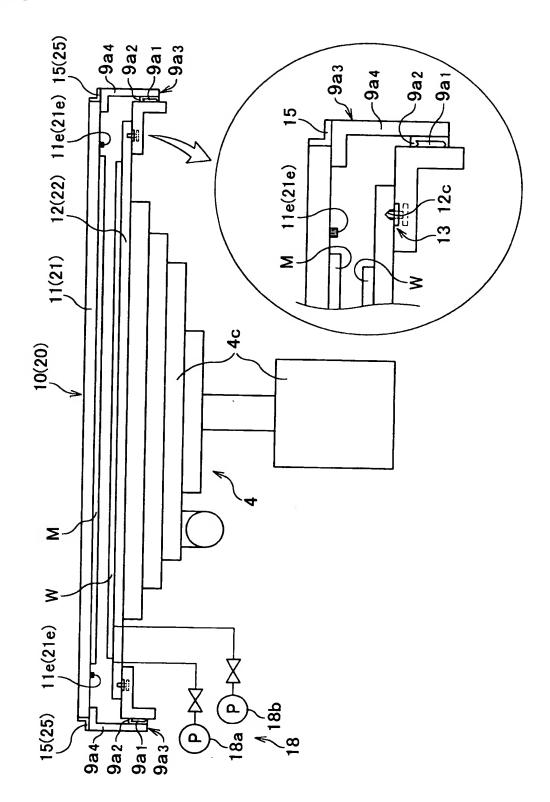
【図2】



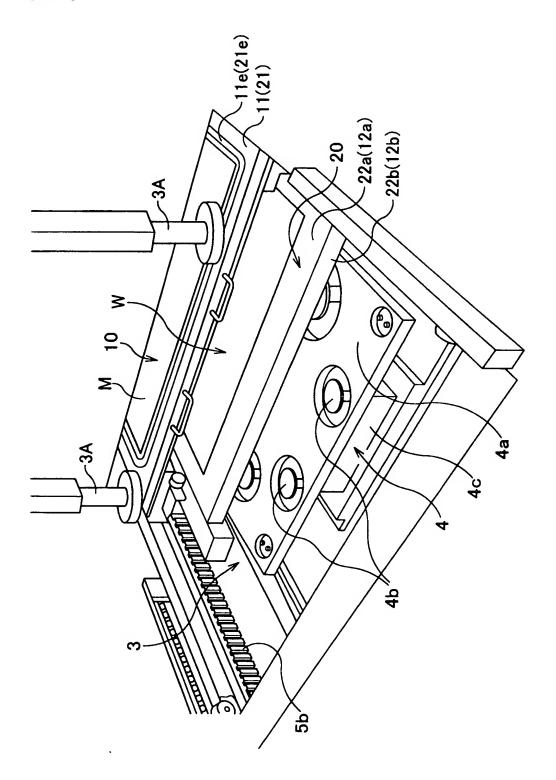
【図3】



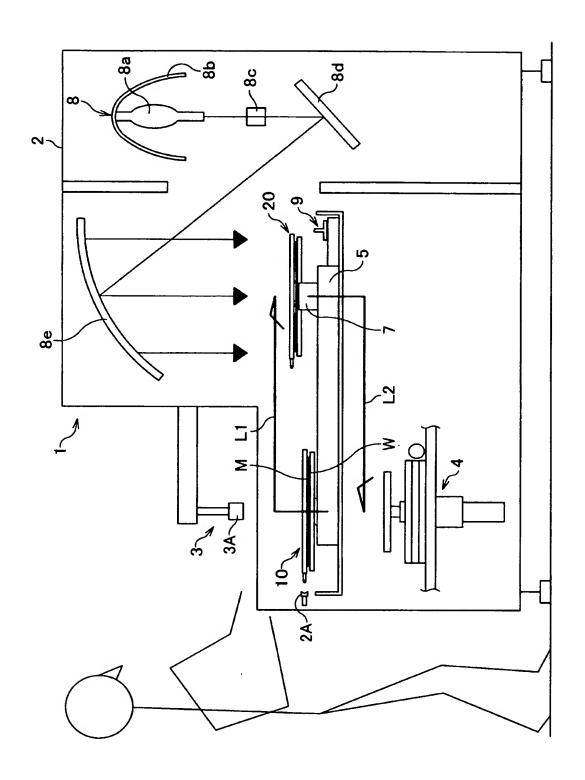
【図4】



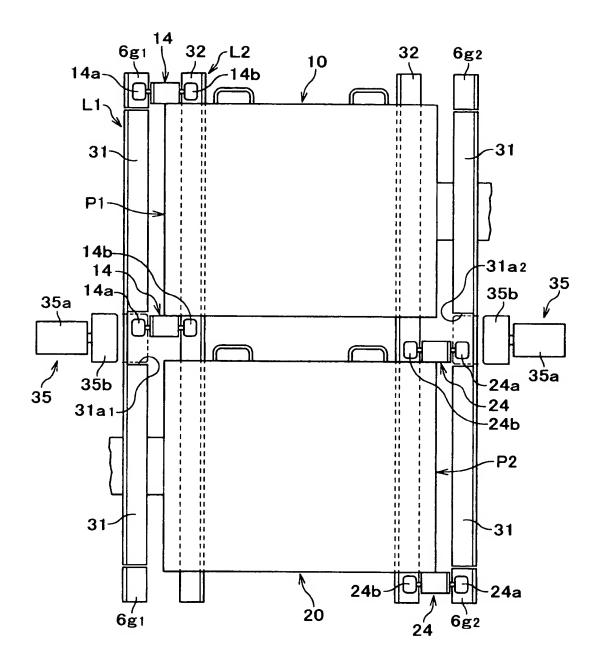
【図5】



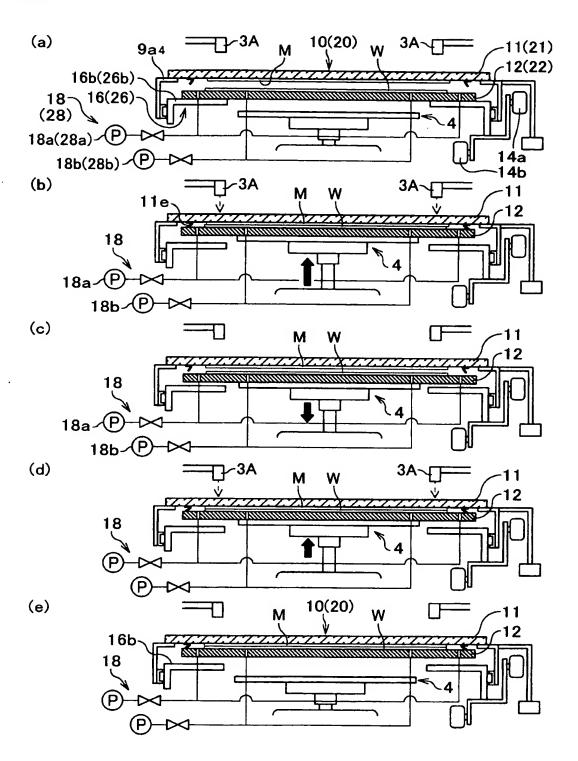
【図6】



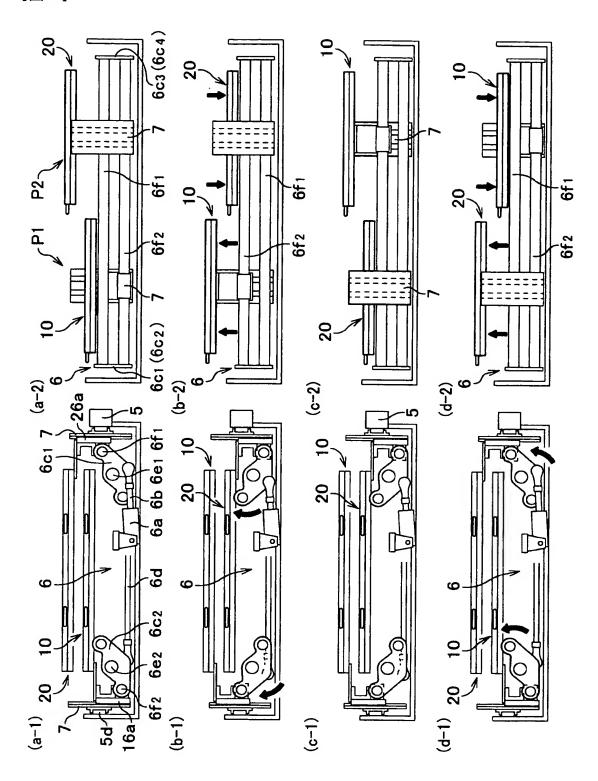
【図7】



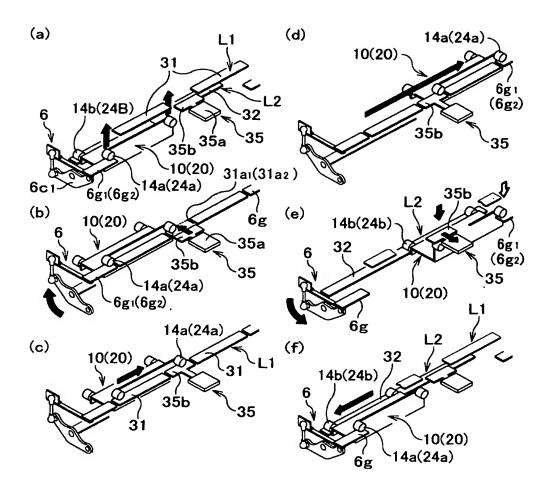
【図8】



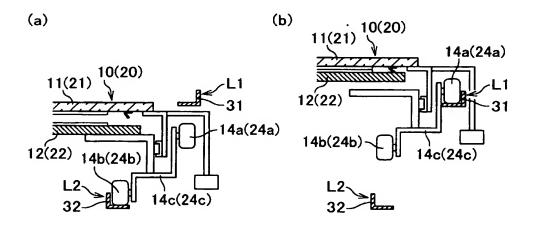
【図9】



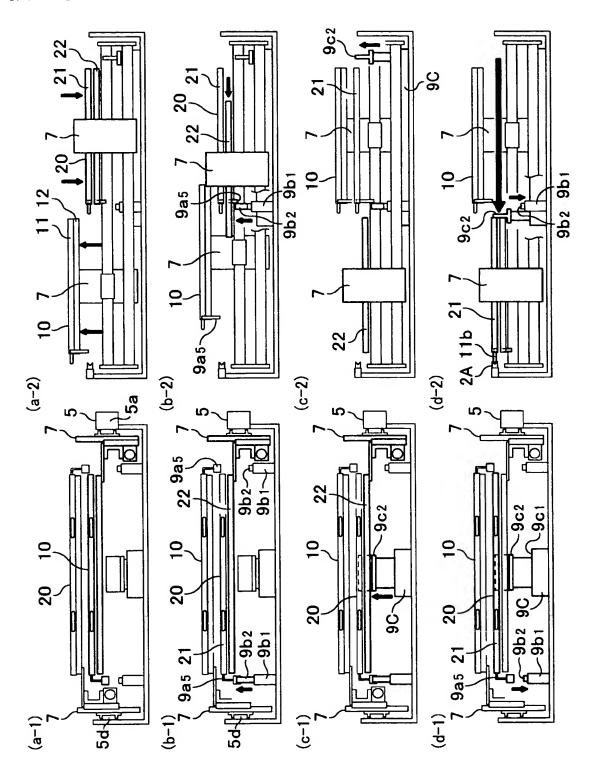
【図10】



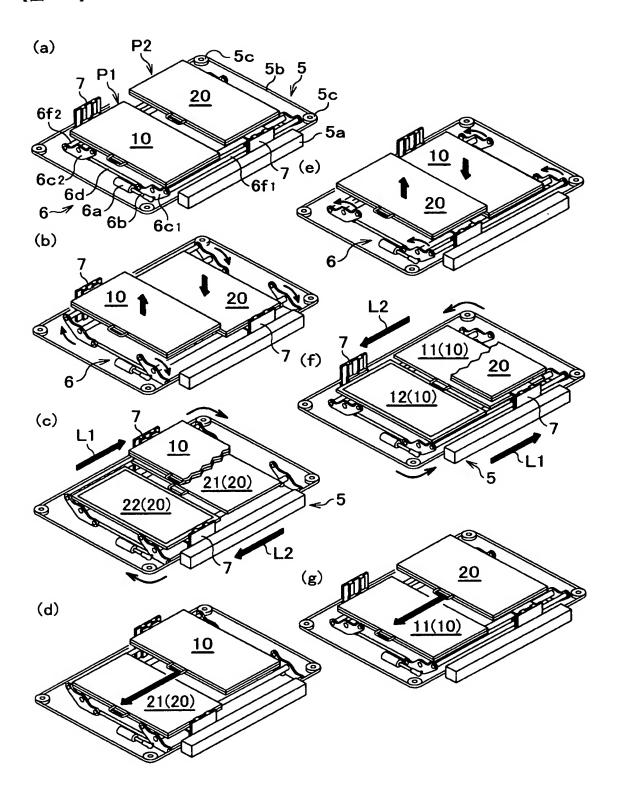
【図11】



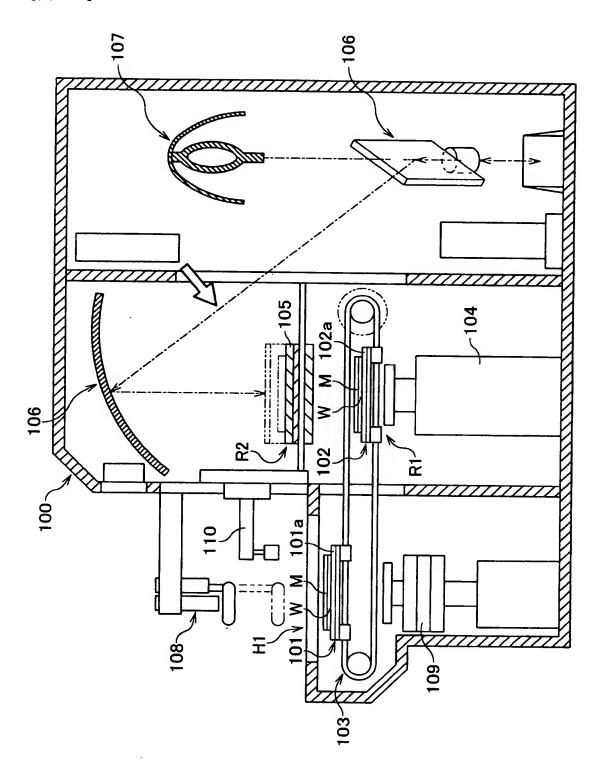




【図13】









【書類名】要約書

【要約】

【課題】ワークに対して高さ方向における整合位置および露光位置が異なることがなく、また、整合作業を行なう場合に作業者が介在することがなく、さらに、 透光板の周囲を囲む金属フレームを必要とせず、マスクが設置される上側透光板の操作が容易となる露光装置およびその方法を提供すること。

【解決手段】搬入搬出位置P1および前記露光位置P2に亘って上下2段に配置された第1搬送経路L1および第2搬送経路L2と、搬入搬出位置に配置された前記第1テーブル体10と、露光位置に配置された前記第2テーブル体20と、前記両テーブル体のそれぞれを異なる前記搬送経路に昇降移動させる昇降機構6と、搬入搬出位置または露光位置にそれぞれ搬送する搬送機構5と、を備え、前記両テーブル体は、ワークを載置するためのステージ板12、22と、前記マスクをあらかじめ設置するための上側透光板11,21とをそれぞれ有する構成とした。

【選択図】 図1



出願人履歷情報

識別番号

[000128496]

1. 変更年月日 1990年 8月21日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都調布市調布ヶ丘3丁目34番1号

氏 名 株式会社オーク製作所

